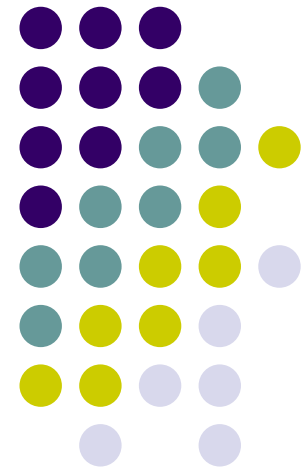


# 晶片表面瑕疵的檢測

學生：吳嘉河

教授：林宸生 老師





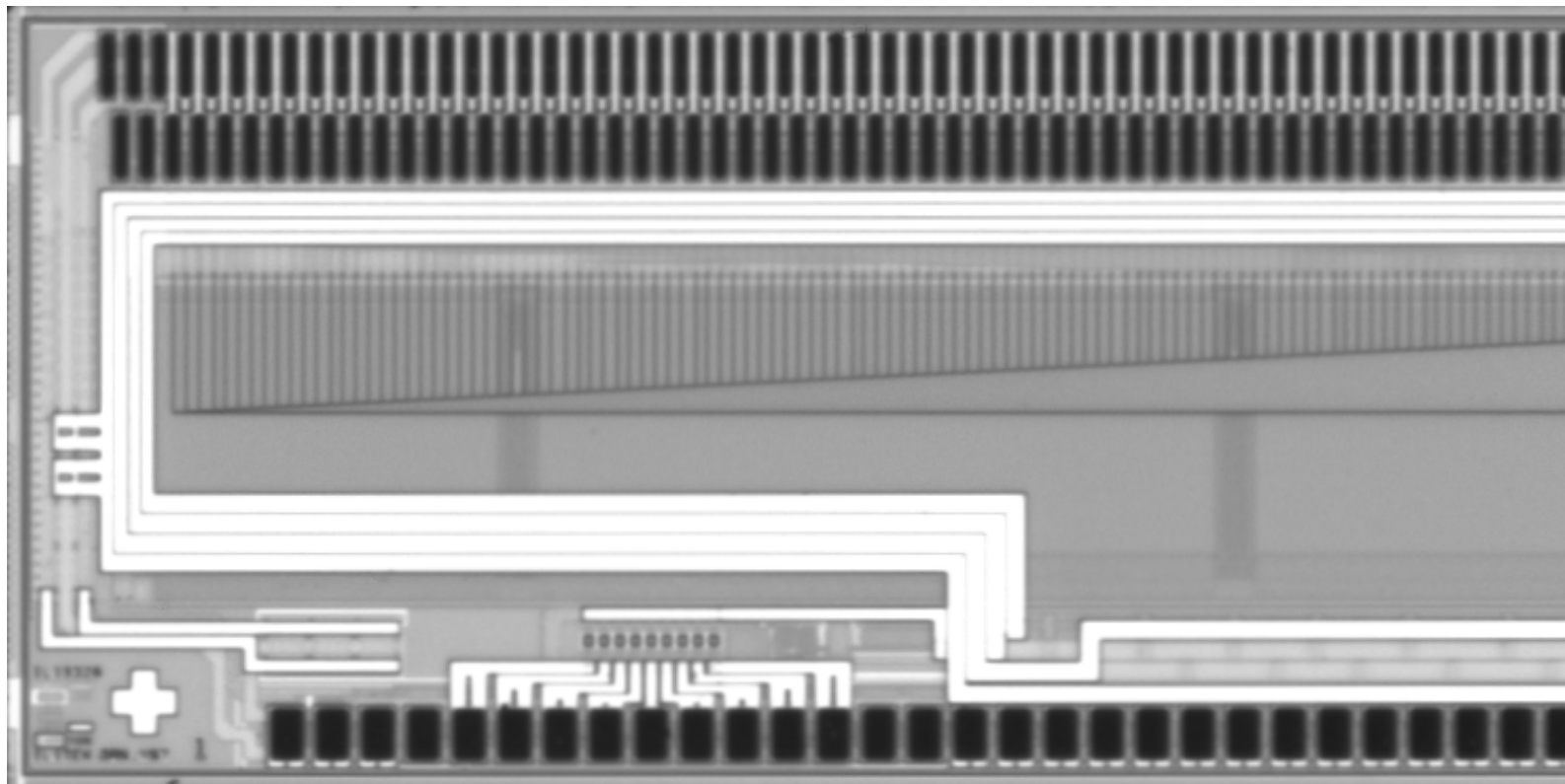
## 實驗與應用

- 爲了減少人工目檢的疏失，以及因應 **Defect size** 逐較縮小，所以開始有了表面瑕疵檢測的 **AOI** 應用產生，而本實驗主要是將影像處理技術，應用於晶片表面瑕疵的檢測，利用影像對位及比對的方法，將晶片上的瑕疵找出來。



# 影像處理原理

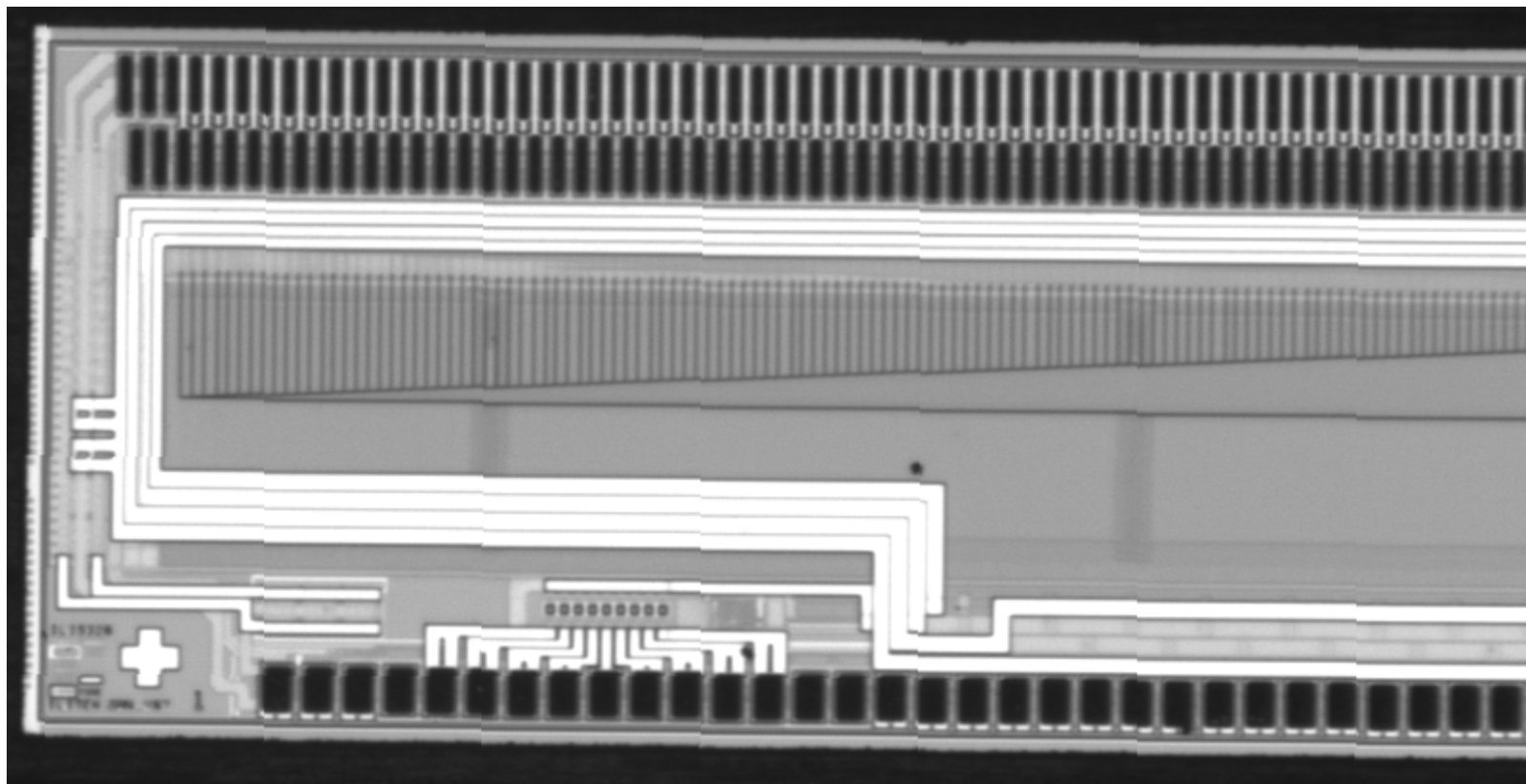
- 1、建立Model影像





# 影像處理原理

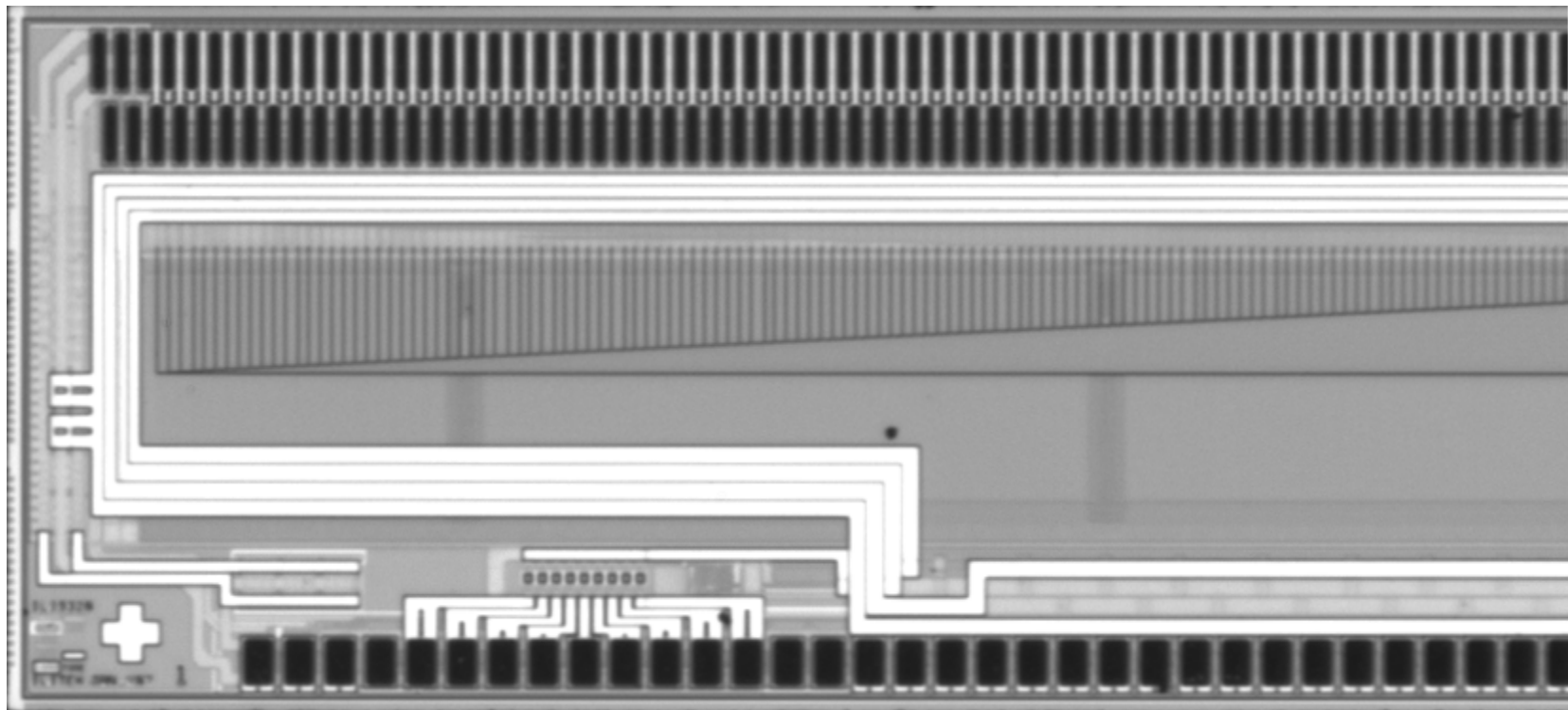
- 2、載入判斷影像





# 影像處理原理

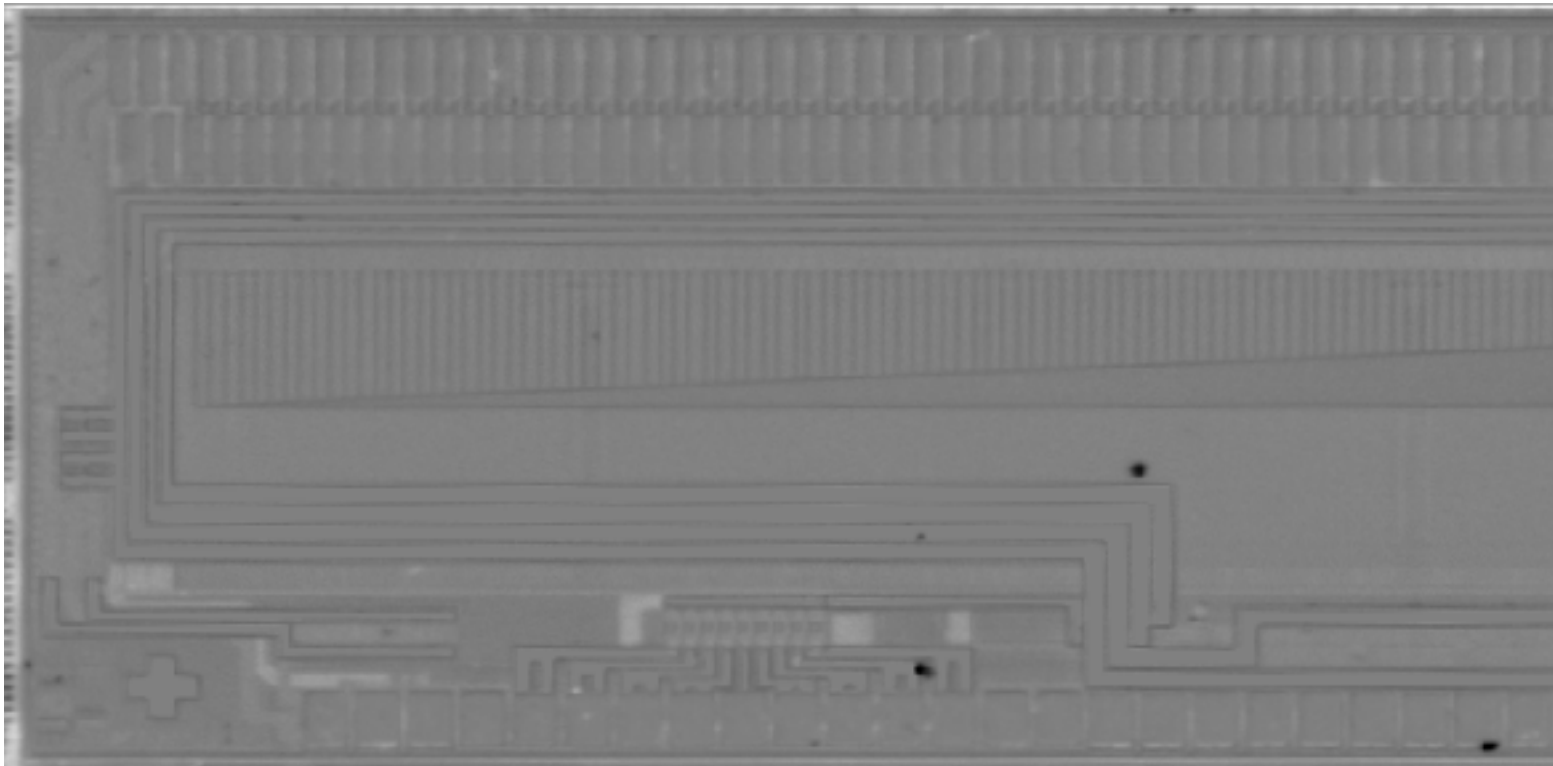
- 3、與Model影像做對位





# 影像處理原理

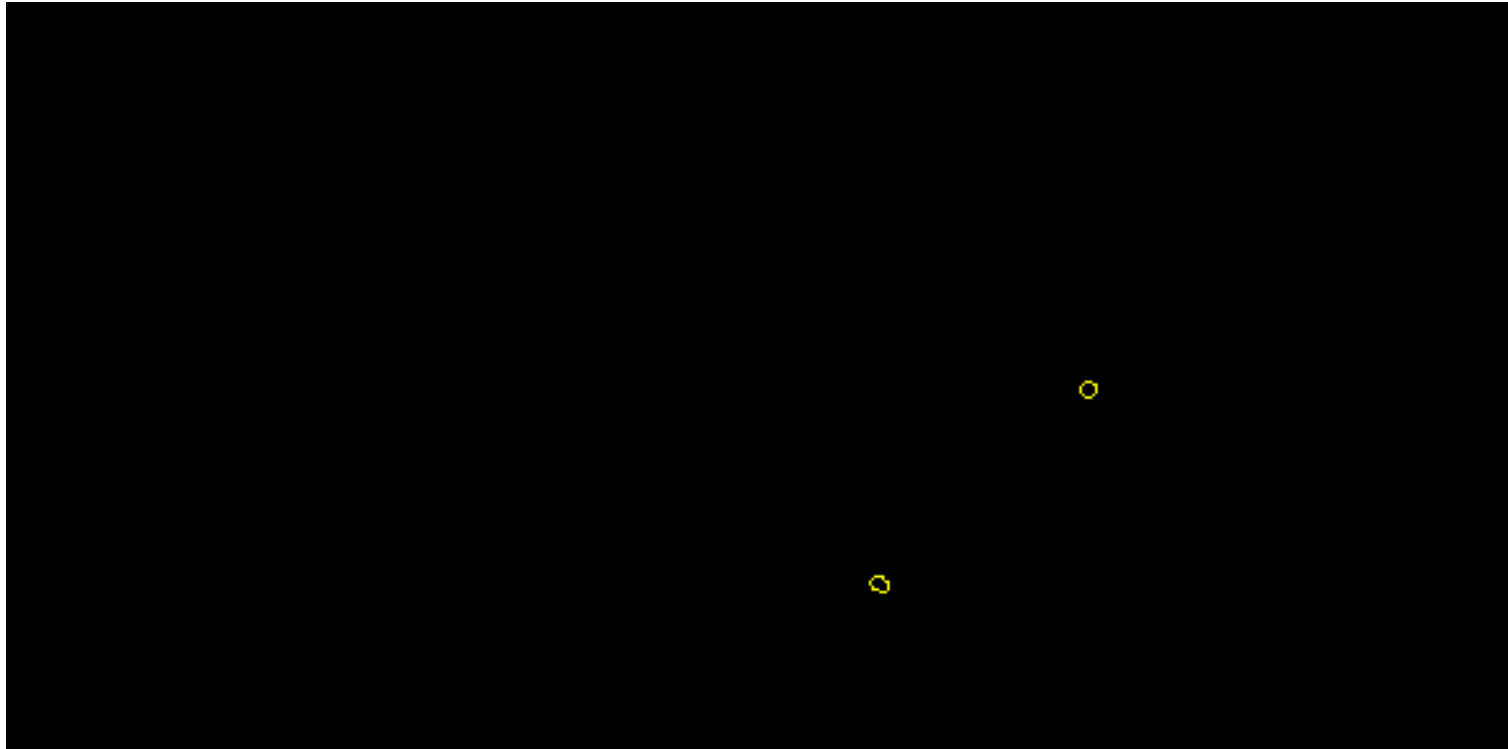
- 4、與Model影像做比對





# 影像處理原理

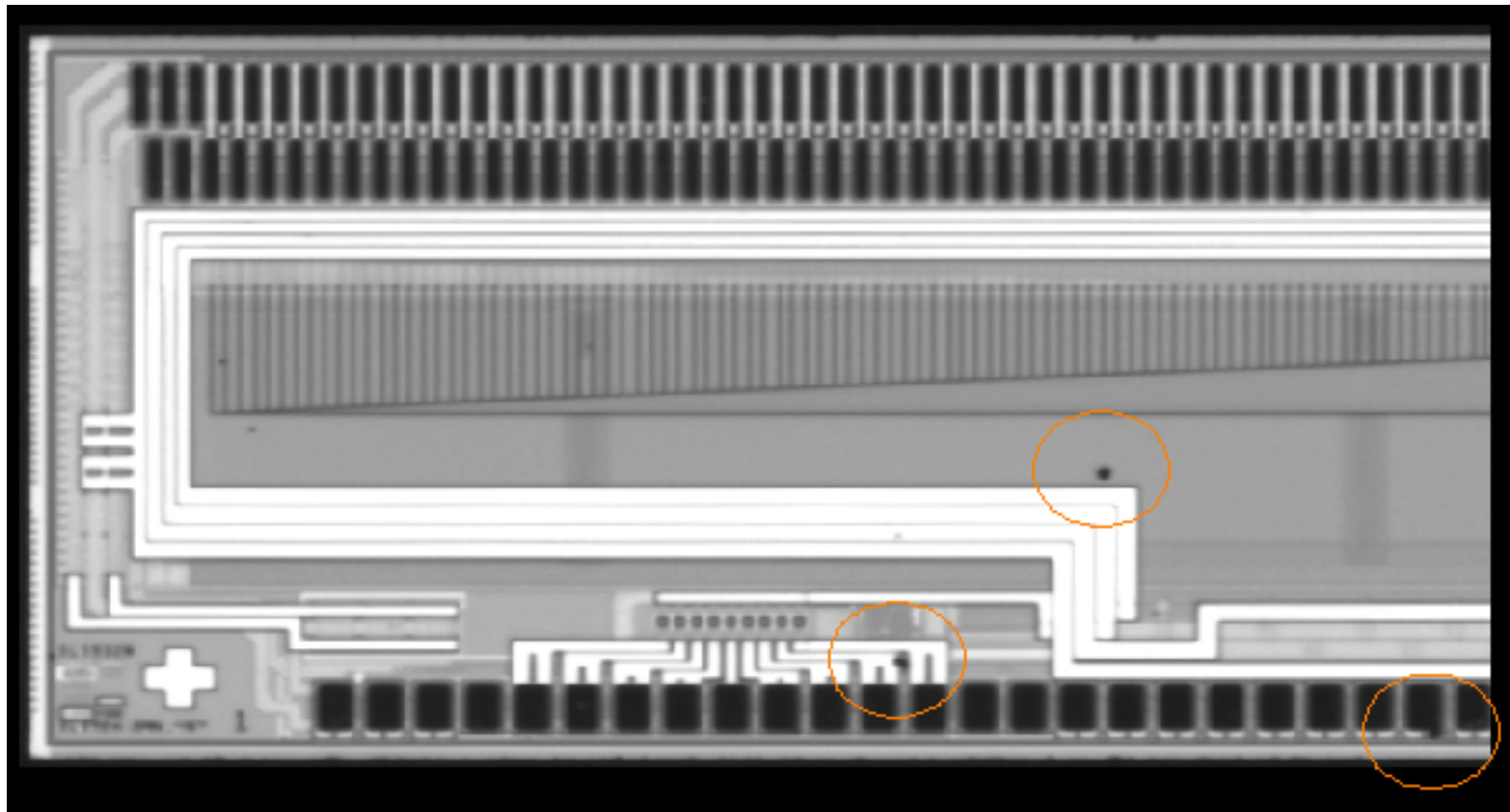
- 5、將Defect標籤化





# 影像處理原理

- 6、顯示檢測結果





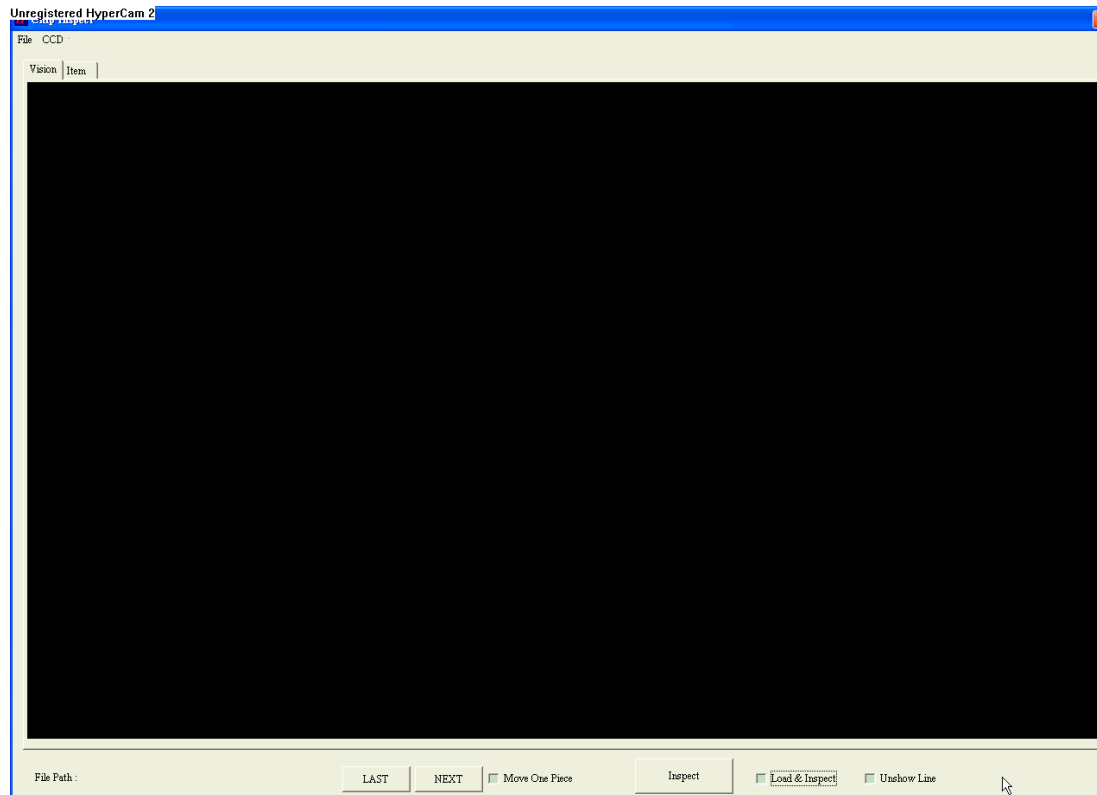
# 軟體功能說明



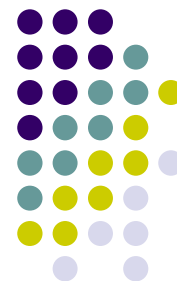
開啟圖片路徑顯示

影像判斷操作介面

# 測試功能影片



- 建立Model影像
- 選擇自動判斷
- 載入圖片
- 執行判斷
- 持續判斷所有影像



報告結束

**Thanks**